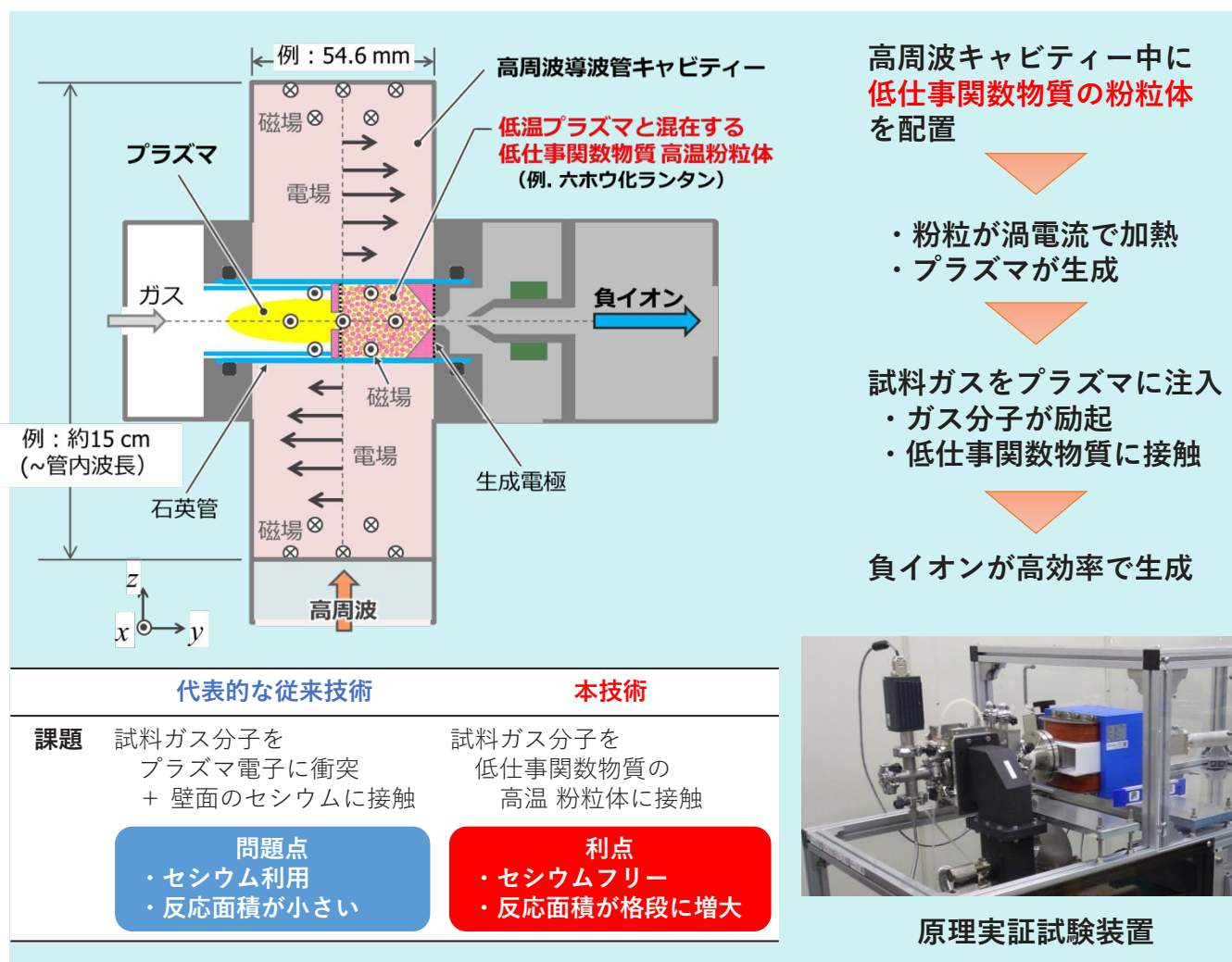


粉粒体の高周波加熱による負イオン生成装置の開発

- セシウムフリーと高い負イオン生成効率を両立
- 電子付着用にセシウムを使用しないので安全
- 負イオン生成面積が従来の10倍以上に増大

キーワード：負イオン源、高周波加熱、低仕事関数物質、セシウムフリー、高効率



技術のステージ

基礎研究

関連業種

業務用機械器具製造業、
電子部品・デバイス・電子回路製造業

利用分野

- ・イオンビーム分析、加速器質量分析
- ・PET等の医療用放射線分野
- ・半導体集積回路の製作プロセス等

知財・関連技術情報
特開2023-119144

技術の詳細

